PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-114526

(43)Date of publication of application: 18.04.2003

(51)Int.CI.

G03F 7/022 G03F 7/004 G03F 7/033 G03F 7/40

H01L 21/027

(21)Application number: 2001-308683

(71)Applicant:

FUJIFILM ARCH CO LTD

(22)Date of filing:

04.10.2001

(72)Inventor:

TAKAGI YOSHIHIRO

(54) POSITIVE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition developable with an alkaline aqueous solution, having a high film leaving property, high resolution and high sensitivity and capable of easily forming a patterned thin film having excellent various characteristics such as heat resistance, solvent resistance, transparency and heat fading resistance, to further provide a photosensitive resin composition capable of easily forming a patterned thin film having excellent low dielectric property as well as the above various characteristics and to provide a pattern forming method using the composition. SOLUTION: The positive photosensitive resin composition comprises a copolymer obtained by copolymerizing at least styrenes and maleic acid amide and a cyclohexane derivative containing a 1,2-naphthoquinonediazido group. In the pattern forming method, when coating, first exposure, development, second exposure and heat treatment of the positive photosensitive resin composition are carried out in this order, the quantity of light for the second exposure is 0.5-15 times that for the first exposure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 / 特開2003-114526 (P2003-114526A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

(51) Int.Cl.'		酸別記号	ΡI	-		テーマコード(参考	
G03F	7/022	601	G03F	7/022	601	2H025	
	7/004	501		7/004	501	2H096	
	7/033			7/033			
	7/40	5 0 1		7/40	501		
H01L	21/027		HO1L 2	21/30	5 0 2 1	R	
			審查請求	未請求	請求項の数 6	OL (全 15	
(21)出顧番号		特顧2001-308683(P2001-3086	(71)出願人	5912210	591221097		
				富士フィ	イルムアーチ株式	式会社	
(22)出廢日		平成13年10月4日(2001.10.4)		東京都渋谷区神宮前6丁目19番20号			
			(72)発明者	高木	支博		
				静岡県村	泰原郡吉田町川島	元4000番地 富士	
				イルムフ	アーチ株式会社は	łj.	
			(74)代理人	1001056	47		
				弁理士	小栗 昌平	(外4名)	
						最終頁に	
			I				

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】アルカリ性水溶液で現像でき、高残膜性、高解像度、高感度であり、しかも、耐熱性、耐溶剤性、透明性、耐熱変色性等の諸特性の優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物、更には、上記諸特性と同時に低誘電特性の優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法を提供すること。

【解決手段】少なくともスチレン類とマレイン酸アミドとを共重合してなる共重合体および1,2-ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体を含有するポジ型感光性樹脂組成物。前記ポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1 解光、現像、第2 解光、加熱処理を順次行う工程において、第2 解光の光量が、第1 解光の0.5~15倍であることを特徴とするパターン形成方法。

【特許請求の範囲】

【 請求項1】 少なくともスチレン類とマレイン酸アミドとを共重合してなる共重合体および1,2-ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項2】 架橋剤を含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項3】 架橋剤は、メラミン系化合物であることを特徴とする請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物

【請求項4】 架橋剤は、エポキシ系化合物であることを特徴とする請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項5】 共重合体が、更にヒドロキシアルキルエステルを構成単位として含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項6】 請求項1~5の何れか1項に記載のポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1露光、現像、第2露光、加熱処理を順次行う工程において、第2露光の光量が、第1露光の0.5~15倍であることを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物に関し、特にミクロなパターン構造を形成することのできる感光性樹脂組成物、さらに詳しくは、半導体集積回路(IC)、液晶ディスプレイ(LCD)用薄膜トランジスタ(TFT)回路等の回路製造用のマスクを作成するためのポジ型レジストとして、さらには液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の層間絶縁膜や固体撮像素子等のマイクロレンズなどの永久膜形成材料としても好適なポジ型感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子、集積回路素子、固体撮像素子等の電子部品の製造においては、その劣化や損傷を防止するための保護膜、素子表面を平坦化するための平坦化膜、電気的絶縁を保つための絶縁膜等が設けられている。又、TFT型液晶表示や集積回路素子においては層状に配置される配線の間を絶縁するために層間絶縁膜が用いられている。一般に、LCD用TFT、IC等の電子部品の製造においては、サブミクロン以下の高解像度を有するとともに高感度を有するレジストが強く要望されている。

【0003】例えば、ICシリコンウェハのウェットエッチング方式で形成されるレジストパターンには、基板との密着性やエッチング液に侵されない耐薬品性が必要とされる。またイオンインプラ工程が加わる場合には、高温加熱に耐えうる耐熱性が要求される。さらにTFTの絶録材料として用いるには、透明性も必要である。し

かし、加熱処理を行うことにより変色するため、液晶カラーフィルターの保護膜やマイクロレンズ等の光学材料 に使用することができないという欠点がある。

2

【0004】また、層間絶緑膜形成は、必要な工程数が多く、層間絶緑膜に要求される諸特性、即ち、平坦性、高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品性、基板との密着性、透明性、絶縁性等を良好に確保することが困難であり、これら諸特性をすべて満足する感光性樹脂組成物がなかった。更に、層間絶緑膜については、デバイスの高密度化にともない、クロストークの発生を抑制するために低誘電性が要望されているが、従来の感光性樹脂組成物では、それら諸特性と低誘電性とを両立させる点で充分満足のいくものではなかった。

【0005】一方、感光性樹脂組成物や感放射線性樹脂組成物の諸特性を改良するために、アルカリ可溶性樹脂やそれを含有した組成物に関しては、これまで数多くの提案がなされている。なかでも、特開2001-242616号公報には、スチレンとマレイン酸アミドを含有する共重合体、1,2-ナフトキノンジアジド基含有化合物、架橋の、及びシランカップリング剤を少なくとも含有するボジ型感光性樹脂組成物が開示されているが、透明性や耐熱変色性において充分満足のいくものではなかった。

【0006】このように、従来の樹脂組成物ではポジ型感光性樹脂組成物に要求される諸特性、即ち高感度で、平坦性、高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品性、基板との密着性、透明性、絶縁性等において満足する組成物は得られなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、アルカリ性水溶液で現像でき、高残膜性、高解像度、高感度であり、しかも、耐熱性、耐溶剤性、透明性、耐熱変色性等の諸特性とともに、従来これらの特性と同時に実現することが困難であった低誘電特性の優れたパターン状薄膜を容易に形成することができる感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記構成の感光性樹脂組成物及びそれを用いたパターン形成方40 法が提供されて、本発明の上記目的が達成される。

【0009】(1)少なくともスチレン類とマレイン酸アミドとを共重合してなる共重合体および1,2-ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体を含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

- (2) 架橋剤を含有することを特徴とする上記(1) に 記載のポジ型感光性樹脂組成物。
- (3)架橋剤は、メラミン系化合物であることを特徴とする上記(2)に記載のポジ型感光性樹脂組成物。
- (4) 架橋剤は、エポキシ系化合物であることを特徴と 50 する上記(2) に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

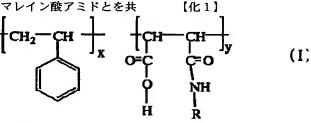
(5) 共**国合体が、**更にヒドロキシアルキルエステルを 構成単位として含有することを特徴とする上記(1)~

- (4) のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物。
- (6) 上記(1)~(5)の何れか1項に記載のポジ型感光性樹脂組成物を、塗布、第1解光、現像、第2解光、加熱処理を順次行う工程において、第2解光の光量が、第1解光の0.5~15倍であることを特徴とするパターン形成方法。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光性樹脂組成物 について詳述する。先ず、本発明の感光性樹脂組成物に 配合される各成分について説明する。

[1] 少なくともスチレン類とマレイン酸アミドとを共



【0013】式(I)中、Rは炭素数1~12のアルキ ル基、炭素数7~14のアラルキル基、炭素数6~18 のアリール基、もしくは炭素数2~14のアルコキシア ルキル基を表す。モル比でx:y=0.85~0.5: 0. 15~0. 50である。上記アミド基は、無水マレ イン酸ユニットに下記等の1級アミンを付加させて作る ことができる。アミンの具体例としては、メチルアミ ン、エチルアミン、プロピルアミン、i-プロピルアミ ン、ブチルアミン、tーブチルアミン、secープチル アミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキ シルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ラウリ ルアミン、ペンジルアミン、フェネチルアミン、アニリ ン、オクチルアニリン、アニシジン、4-クロルアニリ ン、1-ナフチルアミン、メトキシメチルアミン、2-メトキシエチルアミン、2-エトキシエチルアミン、3 -メトキシプロピルアミン、2-ブトキシエチルアミ ン、2-シクロヘキシルオキシエキルアミン、3-エト キシプロピルアミン、3-プロポキシプロピルアミン、 3-イソプロポキシプロピルアミン等を挙げる事ができ る。好ましいアミンの例はアニリン、2-メトキシエチ ルアミン、2-エトキシエチルアミンまたは3-メトキ 40 シプロピルアミンである。特に好ましい1級アミンは、 ベンジルアミン、フェネチルアミンである。

【0014】本発明の共重合体(A)は、上記2成分の他に、更にヒドロキシアルキルエステルを共重合成分として含むことができる。ヒドロキシアルキルエステルとしては、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート等が挙げられる。ヒドロキシアルキルエステル成分は、共重合体(A)中10~30モル%含有することができる。即ち、ヒドロキシアルキルエステル成分を2で表した場合、モル比でx:

重合してなる共重合体(以下、「共重合体(A)」あるいは「樹脂(A)」ともいう。)

【0011】本発明の共重合体(A)は、共重合成分として少なくともスチレン類とマレイン酸アミドを含有する。スチレン類としては、スチレン、 α – メチルスチレン、 α – メチルスチレン・ α – メチルスチレン等が挙げられる。共重合体(A) としては、下記式(I) で表されるスチレンーマレイン酸アミド共重合体が好ましい。この共重合体は、特開平 α – α 2 α 5 α 2 α 8 号公報に記載の方法で合成することができる。

[0012]

20 y: z=0.85~0.5:0.15~0.5:0.1 ~0.3である。

【0015】本発明の共重合体(A)には、上記共重合 成分以外の、その他の共重合成分を構成単位として含有 してもよい。その他の共重合成分としては、アクリル酸 アルキルエステル(例えば、メチルアクリレート、イソ プロピルアクリレート等)、メタクリル酸アルキルエス テル(例えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリ レート、n - プチルメタクリレート、sec - プチルメ タクリレート、 tertープチルメタクリレート等)、 メタクリル酸環状アルキルエステル(例えば、シクロへ キシルメタクリレート、ジシクロペンタニルメタクリレ ート、2-メチルシクロヘキシルメタクリレート、ジシ クロペンタニルオキシエチルメタクリレート、イソポロ ニルメタクリレート等)、アクリル酸環状アルキルエス テル(例えば、ジシクロペンタニルアクリレート、2-メチルシクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニ ルオキシエチルアクリレート、イソポロニルアクリレー ト等)、メタクリル酸アリールエステル(例えば、フェ ニルメタクリレート、ペンジルメタクリレート等)、ア クリル酸アリールエステル(フェニルアクリレート、ベ ンジルアクリレート等)、ジカルポン酸ジエステル(マ レイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタコン酸ジエ チル等) 等が挙げられる。

【0016】本発明の共重合体(A)は、目的とする共 重合体(A)の構造に応じて、適宜、使用する単量体、 重合条件、高分子反応条件、アミン付加条件等を選択す ることによりの製造することができる。

【0017】共重合体(A)の数平均分子量は、ゲルバーミエーションクロマトグラフィー法で、標準物質とし 50 て単分散のポリスチレンを用いて測定したポリスチレン

換算値として、 $500\sim30$, 000であることが好ましく、より好ましくは1, $000\sim20$, 000である。また、質量平均分子量は、好ましくは6, $000\sim25$, 000である。

【0018】共重合体 (A) は、本発明の感光性樹脂組成物中に、 $3\sim35$ 質量%含有されることが好ましく、より好ましくは $5\sim30$ 質量%である。

【0019】本発明の感光性樹脂組成物は、上記樹脂 (A) と共に他のアルカリ可溶性樹脂を併用できる。こ の併用できる樹脂を樹脂(a)とも記す。樹脂(a)と しては、特開平10-307388号公報に記載されて いるアルカリ可溶性環状ポリオレフィン系樹脂、特開2 000-327877号公報に記載されている不飽和力 ルポン酸、エポキシ基含有(メタ)アクリレートおよび その他のオレフィン系不飽和化合物との共重合体、特願 2001-158981に記載されている重合性基を有 するアクリル系樹脂、スチレンと(メタ)アクリル酸と の共重合体、ベンジル (メタ) アクリレートと (メタ) アクリル酸との共重合体等が挙げられる。これらの併用 可能な樹脂(a)は、酸価が50~150の範囲である のが好ましい。また、分子量は1,000~100,00 0、より好ましくは3,000~70,000である。樹 脂(a)は、樹脂(A)に対して、通常、0~50質量 %、好ましくは0~30質量%用いられる。

【0020】 (II) 1,2- ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体

本発明の組成物に感光剤として用いられる1,2- ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体は、好ましくは下記一般式(1)で示されるような1,2-ナフトキノンジアジド基を含有するシクロヘキサン誘導体である。 【0021】

【化2】

$$X_{3}$$
 X_{4}
 X_{5}
 X_{6}
 X_{6}
 X_{7}
 X_{8}
 X_{10}
 X_{9}
 X_{11}
 X_{15}
 X_{14}
 X_{13}
 X_{13}

【0022】一般式(1)において、 $X_1 \sim X_{15}$ は同一でも異なってもよく、水素原子、アルキル基、アルコキシ基または-ODで示される基(ここでDは水素原子もしくはキノンジアジド骨格を有する有機基である。)を示すが、但し、 $X_1 \sim X_{15}$ の少なくとも1つは-OD基である。そして一般式(1)に複数個存在するDのうち

少なくとも 1 個、好ましくは $1\sim5$ 個、さらに好ましくは $2\sim5$ 個はキノンジアジド骨格を有する有機基である。また、一般式(1)において、 $X_1\sim X_5$ の少なくとも一つおよび $X_6\sim X_{10}$ の少なくとも一つは-OD 基であることが好ましい。

6

【0023】X1~X15において、アルキル基としては 炭素数1~4のものが好ましく、その例としては、メチ ル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n ープチル基、t-プチル基等を挙げることができる。ま 10 た、アルコキシ基としては炭素数1~4のものが好まし く、その例としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、n-プトキシ基等を挙げることができる。 【0024】-OD基のDにおけるキノンジアジド骨格 とは、好ましくは下記一般式(4)、下記一般式(5) または一般式(6)で表される骨格である。

[0025]

【化3】

$$\begin{array}{ccc}
& & \cdots & (4) \\
& & & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& &$$

【0026】このようなキノンジアジド骨格を有する有30機基としては、例えば1,2ーベンゾキノンジアジドー4ースルホニル基、1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニル基、1,2ーキノンジアジドー6ースルホニル基、2,1ーナフトキノンジアジドー4ースルホニル基、2,1ーナフトキノンジアジドー5ースルホニル基等が示される。そのうち、特に1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホニルンジアジドー4ースルホニル基および1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニル基および1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホニル基が好ましい。

【0027】一般式(1)において、Dがすべて水素原 40 子である場合に相当する化合物、即ち前記-ODで示さ れる基が水酸基である場合に相当する化合物は一般式

(1) で表わされる化合物の前駆体である [以下、一般式(1) の前駆体を「化合物(a)」という]。

【0028】化合物「(a)」の具体例としては、下記式 $(a-1) \sim (a-18)$ で表される化合物を挙げることができる。

[0029]

【化4】

[0030]

【化5】

[0031]

【化6】

[0032]

【0033】上記化合物(a)は、例えばフェノール類と下記一般式で表わされるケトン化合物

[0034]

【化8】

[0035](式中、 X_{31} \sim X_{35} は同一または異なって、水素原子、アルキル基、好ましくは炭素数 $1\sim$ 4のアルキル基、アルコキシ基、好ましくは炭素数 $1\sim$ 4のアルコキシ基または水酸基を示す。)とを、酸性触媒の存在下で反応させることによって製造することができる。

【0036】このフェノール類としては、フェノール、 o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、 2、5-キシレノール、3、4-キシレノール、レゾルシ ノール、カテコール、ハイドロキノン、メチルハイドロ 50 キノン、フロログルシノール、ピロガロール、p-モノ

メトキシハイドロキノン、m-モノメトキシレゾルシノール、o-モノメトキシカテコール等が好ましい。

【0037】また、上記一般式で表わされるケトン化合物の具体例としては、下記一般式

[0038]

【化9】

【0039】で表わされる化合物を挙げることができる。

【0040】一般式(1)で表わされる化合物としては、前記の化合物(a)の1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-6-スルホン酸エステル、2,1-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホン酸エステルを挙げることができる。これらのうち好ましい化合物は、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等である。

【0041】一般式(1)で表わされる化合物は、例えば化合物(a)と1,2ーキノンジアジドスルホニルハライドとを、塩基性触媒の存在下でエステル化させることにより得ることができる。この場合の化合物(a)と1,2ーキノンジアジドスルホニルハライドとの反応割合は、化合物(a)のフェノール性水酸基1グラム当量当たり、1,2ーキノンジアジドスルホニルハライドが0.2~1モルであるのが好ましく、特に好ましくは0.4~1モルである。

【0042】一般式(1)で表わされる化合物の平均エステル化率は、好ましくは30~100%である。平均エステル化率が30%未満であると、解像性が低下したり、パターン形状が悪くなったりする恐れがる。

【0043】1,2- ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体は、本発明の感光性樹脂組成物中、樹脂(A)100質量部に対して、通常、5~100質量部、好ましくは10~50質量部含んでいることが望ましい。5質量部未満であると、露光によって生成する酸量が少ないため、該組成物から形成される強膜は露光部と未露光部との現像液に対する溶解度差が小さくなってパターニングが困難になることがあり、一方100質量

部を超えると、短時間の光照射では1,2- ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体が充分に分解されず残存するため、感度が低下してしまうことがある。

14

【0044】 [III] 架橋剤

本発明のポジ型感光性樹脂組成物には上記成分の他に、 架橋剤を含有することが好ましい。本発明に用いること ができる架橋剤は、前記樹脂(A)のカルポキシル基な どの官能基と加熱により反応し、架橋結合する機能を有 するものであれば、特に制限されるべきではないが、好 10 ましくは、下記式(I)で表されるメラミン系化合物が挙 げられる。

[0045]

【化10】

20

【0046】式(I)中、 R^5 は、 $-NR^{51}R^{52}$ { R^{51} 、 R^{52} は、各々水素又は $-CH_2OR^{53}$ (R^{53} は水素又は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基またはシクロアルキル基を示す。)を示す。} 又はフェニル基を示し、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 は、各々水素又は $-CH_2OR^{53}$ (R^{53} は水素又は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基またはシクロアルキル基を示す。)を示す。上記 R^{53} のアルキル基またはシクロアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、t-プチル基、n-プテル基、n-プテル基、n-

【0047】本発明に使用される式(1)で表される架橋 剤の具体例としては、例えば、ヘキサメチロールメラミ ン $(R^1, R^2, R^3, R^4, R^{51}, R^{52}$ は、各々 $-CH_2$ OH)及びアルキル化ヘキサメチロールメラミン $(R^1, R^2, R^3, R^4, R^{51}, R^{52}$ は、各々-CH₂O R^{53} 、かつ R^{53} は好ましくは炭素数 $1 \sim 3$) 、部分メチ ロール化メラミン $(R^1, R^2, R^3, R^4, R^{51}, R^{52})$ か ら選択される1~5個は-CH2OHでかつ非選択は水 素)及びそのアルキル化体(好ましくはR⁵³は炭素数1 ~ 3)、テトラメチロールペンゾグアナミン(R^1 . R^2 , R^3 , R^4 は各々-CH₂OHで、 R^5 はフェニル 基)及びアルキル化テトラメチロールベンゾグアナミン (好ましくは R^{53} は炭素数 $1 \sim 3$)、部分メチロール化 ペンゾグアナミン(R^1 , R^2 , R^3 , R^4 から選択される 1~3個は-CH2OHでかつ非選択は水素)及びその アルキル化体(好ましくは R^{53} は炭素数 $1 \sim 3$)、ある いは上記化合物のオリゴマー(好ましくは、単量体2~

5個) 等を挙げることができる。

【0048】本発明で使用される他の架橋剤としては、 エポキシ系化合物、フェノール系化合物、アゾ系化合 物、イソシアネート系化合物等が挙げられ、中でもエポ キシ系化合物が好ましい。例えば、エポキシ系硬化剤と しては、分子中に平均して1個以上のエポキシ基をもつ 化合物であり、例えば、n-ブチルグリシジルエーテ ル、2-エトキシヘキシルグリシジルエーテル、フェニ ルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、エ チレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレング リコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコー ルジグリシジルエーテル、グリセロールポリグリシジル エーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル等のグ リシジルエーテル、アジピン酸ジグリシジルエステル、 o-フタル酸ジグリシジルエステル等のグリシジルエス テル、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4 -エポキシシクロヘキサン) カルポキシレート、3,4 -エポキシ-6-メチルシクロヘキシルメチル(3, 4 -エポキシ-6-メチルシクロヘキサン) カルポキシレ ート、ビス(3,4-エポキシ-6-メチルシクロヘキ シルメチル) アジペート、ジシクロペンタンジエンオキ サイド、ビス(2,3-エポキシシクロペンチル)エー テルや、ダイセル化学工業(株)製のEHPE315 0、セロサイド2021、エポリードGT300、エポ リードGT403などの脂環式エポキシ等が挙げられ る。

【0049】架橋剤は、樹脂(A)に対して2~50質量部の範囲で配合するのが好ましく、より好ましくは4~40質量部である。配合量が少なすぎると感度が低下し、現像不良を起こすことがあり、一方、配合量が多すぎると透明性、絶縁性や塗膜性が悪くなる場合がある。【0050】〔IV〕その他添加剤

本発明のポジ型感光性樹脂組成物には上記成分の他に、 硬化促進のために光重合開始剤を含有することができ る。本発明で用いることのできる光重合開始剤として は、光ラジカル重合開始剤、光カチオン重合開始剤及び 光アミン発生剤等が挙げられる。

【0051】光ラジカル重合剤としては、たとえば、ベンジル、ジアセチル等の α – ジケトン類、ベンゾイン等のアシロイン類、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のアシロインエーテル類、チオキサントン、2,4 – ジエチルチオキサントン、チオキサントンー4 – スルホン酸等のチオキサントン類、ベンゾフェノン、4,4' – ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン、4,4' – ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン等のベンゾフェノン類、ミヒラーケトン類、アセトフェノン、2 – (4 – トルエンスルホニルオキシ) – 2 – フェニルアセトフェノン、p – ジメチルアミノアセトフェノン、 α , α' – ジメトキシアセトキシベンゾフェノン、2,2' – ジメトキ

16

シー2-フェニルアセトフェノン、p-メトキシアセトフェノン、2-メチル [4-(メチルチオ) フェニル] -2-モルフォリノ-1-プロパノン、2-ベンジルー2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタン-1-オン等のアセトフェノン類、アントラキノン、1,4-ナフトキノン等のキノン類、フェナシルクロライド、トリハロメチルフェニルスルホン、トリス(トリハロメチル)-s-トリアジン等のハロゲン化合物、アシルホスフィンオキシド類、ジーt-プチル10 パーオキサイド等の過酸化物等が挙げられる。

【0052】また光ラジカル重合剤として、たとえばIR GACURE-184、同261、同369、同500、同651、同907(チパーガイギー社製)、Darocur-1173、同1116、同2959、同1664、同4043(メルクジャパン社製)、KAYACURE-DETX、同MBP、同DMBI、同EPA、同OA(日本化薬(株)製)、VICURE-10、同55(STAUFFER CO.LTD製)、TRIGONALP1(AKZO CO.LTD製)、SANDORAY 1000(SANDOZ CO.LTD製)、DEAP(APJOHN CO.LTD製)、QUANTACURE-PDの同ITX、同EPD(WARD BLEKINSOP CO.LTD製)等の市販品を用いることもできる。

【0053】また光カチオン重合開始剤としては、ジアソニウム塩類、トリフェニルスルホニウム塩類、メタロセン化合物類、ジアリールヨードニウム塩類、ニトロベンジルスルホナート類、 α -スルホニロキシケトン類、ジフェニルジスルホン類、イミジルスルホナート類が挙げられる。光カチオン重合開始剤として、アデカウルトラセットPP-33、OPTMER SP-150、同170 (旭電化工業 (株) 製) (ジアゾニウム塩)、

OPTOMER SP-150、170 (旭電化工業 (株) 製) (スルホニウム塩)、IRGACURE 2 61 (チバーガイギー (株) 製) (メタロセン化合物) 等の市販品を用いることもできる。

【0054】光アミン発生剤としては、ニトロベンジカーバミメート類、イミノスルホナート類が挙げられる。これらの光重合開始剤は、解光条件(たとえば酸素雰囲気下であるか、無酸素雰囲気下であるか)等によって適宜選択され用いられる。またこれらの光重合開始剤は、2種以上組合わせて用いることもできる。

40 【0055】光重合開始剤は、本発明の感光性樹脂組成物の固形分100質量部に対して、好ましくは0~5質量部、より好ましくは0~2質量部の量で配合される。 光重合開始剤の量が5質量部を超えると、本発明の感光性樹脂組成物から形成される塗膜表面から光重合開始剤がブリードアウトしたり、加熱処理が低下したりすることがある。

【0056】また、本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、光重合性単量体を含むことができこの量及び種類を選定することによりポジ像の物性を調整する手段に用いることができる。光重合性単量体は、酸光により重合す

る成分である。具体的には、単官能性又は多官能性のメタクリレート又はアクリレート(以下、(メタ)アクリレートと記す。)が好ましく挙げられる。また、光重合性単量体はフッ素を含んでいてもよい。

17

【0057】単官能性(メタ)アクリレートとしては、たとえばアロニックスM-101、同M-111、同M-114(東亜合成化学工業(株)製)、KAYARADTC-110S、同TC-120S(日本化薬(株)製)、V-158、V-2311(大阪有機化学工業(株)製)(市販品)等が挙げられる。

【0058】2官能性(メタ)アクリレートとしては、 たとえばアロニックスM-210、同M-240、同M -6200 (東亜合成化学工業 (株) 製)、KAYAR ADDDDA、同HX-220、同R-604(日本化 薬(株) 製)、V260、V312、V335HP(大 阪有機化学工業(株)製)(市販品)等が挙げられる。 【0059】3官能性以上の(メタ)アクリレートとし ては、たとえばトリメチロールプロパントリ (メタ) ア クリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリ レート、トリスアクリロイルオキシエチルホスフェー ト、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレー ト、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレー ト等が挙げられ、具体的に、アロニックスM-309、 同M-400、同M-405、同M-450、同M-7 100、同M-8030、同M-8060 (東亜合成化 学工業(株)製)、KAYARAD DPHA、同TM PTA、同DPCA-20、同-30、同-60、同-120 (日本化薬 (株) 製)、V-295、同-30 0、同-360、同-GPT、同-3PA、同-400 (大阪有機化学工業(株)製)、PPZ(出光石油化学 (株) 製) 等の市販品が挙げられる。

【0060】これらのうち、アロニックスM-400、KAYARAD DPHA等の3官能性以上の多官能性(メタ)アクリレートが好ましく用いられる。これらの単量体は、2種以上組み合わせて用いることもできる。【0061】光重合性単量体は、アルカリ可溶性樹脂(A)100質量部に対して好ましくは0~10質量部、より好ましくは0~3質量部配合される。また本発明に係る感光性樹脂組成物は、シランカップリング剤を40含むことにより基板との密着性を向上させることができる。シランカップリング剤としては、好ましくは、官能性シランカップリング剤などが挙げられる。官能性シランカップリング剤としては、下記のものが例示されるが、中でもS3及びS4が好ましい。

S1. $CH_2=CHSi$ (OC₂H₅)₃

S2. $CH_2 = CHSi$ (OCH₂H₄OCH₃) 3

S3. γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン:

[0062] (化11] H₂C——CHCH₂OCH₂CH₂Si(OCH₃)₃

【0063】S4. γ - メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン:

18

[0064]

10 【化12】

【0065】S5. アーメルカプトプロピルトリメトキシシラン: HSC3H6Si (OCH3)3 シランカップリング剤は、アルカリ可溶性樹脂(A)に対して、0.01~5質量部用いられることが好ましい。これらは2種以上用いることもできる。このような 20 界面活性剤は、感光性樹脂組成物中の全量を100質量部とするとき、2質量部以下好ましくは1質量部以下の量で含有していてもよい。

【0066】本発明の感光性樹脂組成物は、その硬化膜中にフッ素原子が含有されるように、好ましくは本発明の感光性樹脂組成物の固形分中にフッ素原子を3質量%以上、より好ましくは5~30質量%含有させることにより、他の諸特性に加え低誘電特性の優れたパターン状薄膜をより容易に形成することができる。このような低誘電特性の優れたパターン状薄膜を与え得るフッ素原子源としてフッ素化合物が用いられる。本発明においし、新では発情剤に結合されてもよいし、感光時や加熱時に樹脂(A)に含まれるカルボキシル基に結合されてもよいし、あるいは架橋剤に結合されてもよく、さらにはフッ素化合物によいし、これらと反応することなく感光性樹脂組成物の混合物として存在していてもよい。フッ素化合物の典型的な例は、下記(1)~(8)に示される含フッ素基が結合した化合物である。

[0067] (1) $F(CF_2)_n$ -

(2) $(C F_3)_2 C F (C F_2)_{n-2}$

9 (3) $H(CF_2)_n-$

(4) CF₃CHFCF₂-

 $(5) (CF_3)_2CH-$

 $(6) - (CF_2CC1F) -$

[0068]

【化13】

50

【0069】ここで、nは通常、1~10、好ましくは5~8である。また、式(7)及び(8)において、ペンゼン環の水素は、フッ素その他の置換基で置換されていてもよいし、ペンゼン環は脂環式化されてもよい。

【0070】フッ素化合物として、アルコール類、カルポン酸類、エポキシ化合物類、オレフィン類、ハロゲン化化合物、アクリレート類、メタクリレート類、エステル類、エーテル類、アミン類等を挙げることができる。なかでも、エポキシ化合物類、アクリレート類、メタクリレート類、アミン類が好ましい。

【0071】これらフッ素原子を含有するエポキシ化合物類、アクリレート類、メタクリレート類、アミン類の具体例として、下記表1に示される基と上記(1)~

10 (8)に示される含フッ素基とが結合した化合物を挙げることができる。

[0072]

【表1】

【0073】上記表1の枠のなかに、例えばエポキシ化合物類としてエポキシを含む基が記載されているが、そのエポキシ化合物類とは、その基と上記(1)~(8)に記載されている含フッ素基等とが結合して形成される種々のエポキシ化合物を意味する。その他の化合物類についても同様である。フッ素化合物としては、中でもエポキシ化合物類及びアミン類が好ましく、特に上記

(7)及び(8)などの芳香族系の含フッ素基を有したフッ素化芳香族エポキシ化合物、上記(1)などの脂肪族の含フッ素基を有したフッ化脂肪族化合物が好ましい。フッ素化芳香族エポキシ化合物の好ましい例としては、

[0074]

【化14】

F1:
$$H_2C$$
 $CHCH_2$ CH_2 CH_3 CF_3 CCF_3 CCH_2 CCH_2 CCH_2 CCH_3 CCH_3 CCH_4 CCH_4 CCH_5 CCH

【0075】2, 2´ー[1, 3ーフェニレンピス ル) エチリデン]オキシメチレン]]ピスーオキシラン [[2, 2, 2ートリフルオロー1ー(トリフルオロメチ 50 【0076】

【化15】

F2:
$$H_2C$$
 CHC H_2 O CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_3$ CH $_3$ CH $_4$ CH $_2$ CH $_4$ CH $_2$ CH $_3$ CH $_4$ CH $_4$ CH $_5$ CH $_5$

【0077】2,2-ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパンが挙げられ、フッ化脂肪族化合物の好ましい例としては、

[0078]

【化16】

F4: F(CF₂)₇ CH₂NH₂

【0079】が挙げられる。

【0080】本発明の感光性樹脂組成物は、樹脂(A)及び1,2-ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体、他に必要に応じて架橋剤、光重合開始剤、シランカップリング剤、フッ素化合物等を溶媒に溶解して調製される。

【0081】本発明の感光性樹脂組成物を溶解するため の溶媒としては、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー テル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレン グリコールジプロピルエーテル、プロピレングリコール モノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチル エーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピ レングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコー ルジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチル エーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレ ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール ジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエー テルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル アセテート、エチレングリコールモノフェニルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル アセテート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテ ルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテ ルアセテート、ジエチレングリコールモノフェニルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエー

テルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエ ーテルアセテート、2-メトキシブチルアセテート、3 -メトキシプチルアセテート、4-メトキシプチルアセ 10 テート、2-メチル-3-メトキシブチルアセテート、 3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-エチ ルー3-メトキシブチルアセテート、2-エトキシブチ ルアセテート、4-エトキシブチルアセテート、4-プ ロポキシブチルアセテート、2-メトキシペンチルアセ テート、3-メトキシペンチルアセテート、4-メトキ シペンチルアセテート、2-メチル-3-メトキシペン チルアセテート、3-メチル-3-メトキシペンチルア セテート、3-メチル-4-メトキシペンチルアセテー ト、4-メチル-4-メトキシペンチルアセテート、ア 20 セトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチル シソプチルケトン、エチルイソプチルケトン、テトラヒ ドロフラン、シクロヘキサノン、プロピオン酸メチル、 プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロピル、プロピオ ン酸イソプロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸メチ ル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキ シー2-メチル、メチルー3-メトキシプロピオネー ト、エチル-3-メトキシプロピオネート、エチル-3 -エトキシプロピオネート、エチル-3-プロポキシプ ロピオネート、プロピル-3-メトキシプロピオネー ト、イソプロピルー3-メトキシプロピオネート、エト キシ酢酸エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー 3-メチルプタン酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、 酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イ ソアミル、炭酸メチル、炭酸エチル、炭酸プロピル、炭 酸プチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピル ピン酸プロピル、ピルビン酸プチル、アセト酢酸メチ ル、アセト酢酸エチル、ペンジルメチルエーテル、ペン ジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、酢酸ペンジ ル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジ エチル、ァープチロラクトン、ペンゼン、トルエン、キ シレン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、 プロパノール、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキ サノール、エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、グリセリン等を挙げることができる。

【0082】また本発明では、感光性樹脂組成物の塗布性の向上たとえばストリエーション(塗布すじあと)の防止、また塗膜の現像性を向上させるために界面活性剤を配合することもできる。界面活性剤としては、たとえば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオレエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレ

イルエーテルなどのポリオキシエチレンアルキルエーテ ル類、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、 ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどのポリ オキシエチレンアリールエーテル類、ポリオキシエチレ ンジラウレート、ポリオキシエチレンジステアレートな どのポリオキシエチレンジアルキルエステル類などのノ ニオン系界面活性剤、エフトップEF301、同30 3、同352 (新秋田化成(株) 製)、メガファックF 1.71、同F172、同F173、同F177(大日本 インキ化学工業(株)製)、フロラードFC-430、 同FC-431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガ ードAG710、サーフロンS-382、同SC-10 1、同SC-102、同SC-103、同SC-10 4、同SC-105、同SC-106(旭硝子(株) 製) などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤、 オルガノシロキサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製)、(メタ)アクリル酸系共重合体ポリフロー No. 57、95 (共栄社油脂化学工業 (株) 製) などが 挙げられる。

【0083】これらは2種以上用いることもできる。このような界面活性剤は、感光性樹脂組成物中の全量を100質量部とするとき、2質量部以下好ましくは1質量部以下の量で含有していてもよい。

【0084】また、感光性樹脂組成物の耐熱性、基板と の密着性を向上させるために、分子内に少なくとも2個 のエポキシ基を有する化合物を含んでいてもよい。この ようなエポキシ基含有化合物としては、たとえば、エピ コート1001、同1002、同1003、同100 4、同1007、同1009、同1010、同828 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのピスフ エノールA型エポキシ樹脂、エピコート807 (商品 名;油化シェルエポキシ(株)製)などのピスフェノー ルF型エポキシ樹脂、エピコート152、同154(商 品名;油化シェルエポキシ(株)製)、EPPN20 1、同202 (商品名;日本化薬(株)製)などのフェ ノールノポラック型エポキシ樹脂、EOCN102、同 1035、同1045、1020、1025、1027 (商品名;日本化薬(株)製)、エピコート180S7 5 (商品名;油化シェルエポキシ(株)製)などのクレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂、CY-175、同1 77、同179、アルダライトCY-182、同19 2、184 (商品名: チバーガイギー (株) 製)、ER L-4234、4299、4221、4206 (商品 名; U. C. C社製)、ショーダイン509 (商品名; 昭和電工(株)製)、エピクロン200、同400(商 品名;大日本インキ(株)製)、エピコート871、同 872 (商品名;油化シェルエポキシ(株) 製)、ED -5661、同5662 (商品名; セラニーズコーティ ング(株)製)などの環状脂肪族エポキシ樹脂、エポラ イト100MF (共栄社油脂化学工業 (株) 製)、エピ 50

オールTMP(日本油脂(株)製)などの脂肪族ポリグリシジルエーテルなどが挙げられる。

【0085】これらのうちでも、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールF型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、脂肪族ボリグリシジルエーテルなどが好ましく用いられる。

【0086】上記のようなエポキシ基含有化合物の分子 量は特に限定されることはなく、高分子量であってもよ く、またピスフェノールA(またはF)のグリシジルエ ーテルなどのような低分子量であってもよい。

【0087】任意成分としてのエポキシ基含有化合物は、樹脂(A)100質量部に対して、5~50質量部の量で必要に応じて用いられる。更に、本発明の感光性樹脂組成物においては、必要に応じて、帯電防止剤、保存安定剤、ハレーション防止剤、消泡剤、顔料等を添加することもできる。

【0088】本発明の感光性樹脂組成物を用いることに より、例えば次のようにしてパターンを形成することが できる。先ず、各成分を、例えばその固形分の濃度が5 ~60質量%となるように溶媒に溶解して、これを孔径 0.2~10μm程度のフィルターで濾過することによ り本発明の感光性樹脂組成物溶液を調製する。そして、 この本発明の感光性樹脂組成物溶液をシリコンウェハー 等の基板の表面に塗布し、プリベークを行うことにより 溶剤を除去して感光性樹脂組成物の塗膜を形成する。次 いで、形成された塗膜に対して光照射処理などの放射線 照射処理(第1 図光)を行った後、現像処理を行って放 射線照射部分を除去することによりポジパターンが形成 される。また現像により得られたパターンの耐溶剤性、 膜強度、耐熱性等の諸特性を向上させるため、更に露光 (第2 露光) してもよく、さらに露光の効果を高めるた め、 露光前、露光中あるいは露光後のいずれかで、パ ターンを加熱してもよい。この加熱処理は、好ましく は、露光後に施されることが好ましく、また、第2露光 の光量が、第1 露光の 0. 5~15 倍であることが好ま しい。本発明の方法では、第2 図光量は、第1 図光の図 光量を $20\sim150\,\mathrm{mJ/cm^2}$ としてその $0.5\sim1$ 5倍とすることが好ましい。また、加熱処理は、100 40 ~220℃、3~60分が好ましい。

【0089】本発明の感光性樹脂組成物溶液を基板に塗布する方法としては、回転塗布法、流し塗布法、ロール塗布法等の各種の方法を採用することができる。プリベークの条件は、例えば加熱温度が50~150℃、加熱時間が30秒間~600秒間である。放射線照射処理に使用される放射線としては、超高圧水銀燈等からの紫外線で、波長365nmのi線、波長405nmのh線、436nmのg線、波長248nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザー等の 遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線あるいは電子

線等の荷電粒子線が挙げられる。

【0090】現像処理に用いられる現像液としては、好 ましくは、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウ ム、硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア 水、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミ ン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メチ ルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエ タノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、 ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザピシクロ〔5. 4.0] - 7 - ウンデセン、1.5 - ジアザビシクロ 〔4.3.0〕 - 5 - ノナン等が溶解されてなるアルカリ 水溶液が挙げられる。また、このアルカリ水溶液等に、 水溶性有機溶媒、例えばメタノール、エタノール等のア ルコール類や、界面活性剤が適量添加されてなるものを 使用することもできる。現像処理時間は、例えば10~ 300秒間であり、現像方法としては、液盛り法、ディ ッピング法、揺動浸渍法等を利用することができる。ア ルカリ現像後、流水洗浄によるリンス処理を行うが、リ ンス処理としては、超高圧マイクロジェットで水洗する ことが好ましい。

【0091】超高圧マイクロジェットは、高圧噴射装置 から水が噴射される。超高圧マイクロジェットの印加圧 力は、通常、 $20\sim350$ kg f/cm²(2.9~3) 4. 3MPa)、好ましくは30~250kgf/cm ² (4. 9~24. 5MPa) のものを指す。該印加圧 力は、ノズルの形状によって選定され、本発明では、猫 目型ノズル(断面が凹レンズ状)が好ましい。超高圧マ イクロジェットの噴射角は、水洗作用に大きな影響を及 ぼす。感光性樹脂組成物の面に対して垂直である場合 が、もっとも水洗作用は強い。一方、非感光部の組成物 の除去は、単に水洗作用が強いだけでは不十分で、機械 的な水の衝撃によって不要の組成物を基板から除去しな ければないが、そのためには噴射方向は基板に対して垂 直方向が最も良いが、またその垂直方向と基板への噴射 方向とのなす角度が、±0~20度ほどとして基板の進 行方向に対して前または後ろに噴射してもよい。

【0092】また、本発明の経済的な実施形態として連続水洗を採用するのが実際的であるが、その場合に感光性樹脂組成物層の幅方向に水が均等に行きわたるように、扇型のひろがりをもって噴射する噴射ノズルを単独または扇のひろがり方向に複数配列し、その扇面状の噴射の方向に対して直角方向に感光性樹脂組成物を定速移動しながら水の噴射部分を通過する方法をとって連続水洗処理を行うことが好ましい。

【0093】この方法では、非蹊光部層の深部でも効果的に除去されるので、層厚の大きな一般には除去しにくい組成物にも使用することも可能であり、プロファイルの良好なパターンを形成させることができる。

【0094】上記の噴射圧、衝撃角度、水流ひろがり形 50 記方法で評価した。

状などを満たすための機能を有して特に好ましく使用できる高圧噴射装置は、超高圧ジェット精密洗浄システムAFシリーズ(旭サナック(株))が挙げられる。中でも相対的に高圧な噴射用にはAF5400Sが、相対的に低圧な噴射用にはAF2800IIが、適している。しかしながら、上記の噴射印加圧、衝撃角度及び水流ひろがり形状等を有する装置であれば、この機種に限定されず、本発明のパターン形成方法における現像後の水洗手段に適用できる。

26

10 【0095】この方法では、超高圧マイクロジェットの 効果が強力でかつ深部に及ぶので、水による水洗で非パ ターン部が実質的に除去される。

【0096】バターン化されている樹脂組成物は、上記水洗処理の後、例えば圧縮空気や圧縮窒素で風乾し、前記第2解光、加熱処理を行い硬化したパターン状薄膜が基板の上に形成される。こうして得られるパターン状薄膜は、高解像度、平坦性、高解像性、現像性、耐熱性、耐薬品性、基板との密着性、透明性、絶縁性等の物性に優れる。また、感光性樹脂組成物において、フッ素化合20 物を更に含むものは、上記特性に加えてその比誘電率は3以下、好ましくは2.8以下と低いものである。したがって、本発明の感光性樹脂組成物は電子部品の保護膜、平坦化膜、層間絶縁膜等に有用であり、特に液晶表示素子、集積回路素子及び固体撮像素子の層間絶縁膜、固体撮像素子等のマイクロレンズに有用である。

[0097]

【実施例】以下、本発明の感光性樹脂組成物を実施例に 基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるもの ではない。

30 【0098】 実施例1

スチレン/マレイン酸ペンジルアミド共重合体樹脂(65/35(モル比)、質量平均分子量約1.5万)60質量部、上記感光剤(1,2-ナフトキノンジアジド基含有シクロヘキサン誘導体)a-1(2S:3個の水酸基のうち2個が置換)15質量部、ヘキサメトキシメチロールメラミン12質量部、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート200質量部を混合して提拌溶解して、感光性樹脂組成物を調製した。

【0099】これを、ガラス基板(コーニング705409)上に膜厚が、2μmとなる様、スピン塗布した後、ホットプレート上で、110℃、2分間乾燥させ、4μm角のL/Sパターンのマスクを通して、超高圧水銀灯を用いて100mJ/cm²の軽光量で軽光を行い、1.5%テトラメチルアンモニウムヒドロキシドアルカリ溶液にて、25℃で60秒間現像し、水洗、乾燥して、微細パターンを得た。その後、基板全体を400mJ/cm²の軽光量で第2酸光し、220℃で10分間加熱処理して硬化させた。

【0100】得られたパターン状加熱硬化膜の特性を下 記方法で駆伍した 【0101】(1) 比誘電率の測定:上記で得られた加熱硬化膜の比誘電率を、室温、1MHzの条件で誘電率測定装置(ヒューレットパッカード社製)を用いて測定した。比誘電率は、3.1であった。

27

【0102】(2)耐熱性の評価

. . . .

上記の加熱硬化膜の膜厚を測定した後、更に220℃のオープン内で30分間加熱した。そして、加熱処理後の膜厚を測定した。加熱による膜厚の変化はほとんどなかった。

【0103】(3) 耐溶剤性の評価

上記の加熱硬化膜を、室温でNMP溶液に10分間浸漬し、水洗、乾燥後膜厚を測定した。浸漬による膜厚変化はほとんどなかった。

【0104】(4)透明性の測定

上記の加熱硬化膜をダブルピーム型分光光度計を用いて、波長380-700nmで測定し、透過率を求めた。膜は透明で長波長の吸収はほとんどなく、短波長でも400nmの透過率も96%であった。

【0105】(5)耐熱変色性の評価

上記の加熱硬化膜を、更に230℃のオープン内で30分間加熱した後、上記と同様な方法で、透過率を測定した。400nmの透過率の変化は3%であり、ほとんど着色変化が見られなかった。

【0106】比較例

%、変色性の変化は6%あり、実施例1に比べると良好ではなかった。

【0107】 実施例2

実施例1において、感光剤として使用した a - 1 を、 a - 9 に変更した他は、実施例1と同様に感光性樹脂組成物を調製した。

【0108】 実施例3

実施例1において、感光剤として使用した a - 1 を、 a - 1 7に変更した他は、実施例1と同様に感光性樹脂組 10 成物を調製した。

【0109】 実施例4

実施例1において、感光剤として使用したa-1を、a-18に変更した他は、実施例1と同様に感光性樹脂組成物を調製した。

【0110】 実施例5

実施例1において、感光剤として使用したa-1を、a-8に変更した他は、実施例1と同様に感光性樹脂組成物を調製した。

【0111】上記実施例2~5の感光性樹脂組成物を実 20 施例1と同様に処理して得られたパターン状加熱硬化膜 の特性を上記方法で評価したところ、比誘電率、耐熱 性、耐溶剤性、透明性及び耐熱変色性について、ほぼ同 様であった。

[0112]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、アルカリ性水溶液で現像でき、高残膜性、高解像度、高感度であり、しかも耐熱性、耐溶剤性、透明性、耐熱変色性等の諸特性とともに、従来これらの特性と同時に実現することが困難であった低誘電特性の優れたパターン状薄膜を好ましくは本発明のパターン形成方法により容易に形成することができる。従って、本発明の感光性樹脂組成物は、半導体集積回路、液晶ディスプレイ用薄膜、トランジスタ回路等の回路製造用のマスクを作成するためのポジ型レジストとして、さらには層間絶縁膜、カラーフィルタ用保護膜、マイクロレンズ等の永久膜形成材料としても好適に使用することができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AA02 AA06 AA10 AA14 AA20 AB14 AB16 AC01 AD03 BE01 CB10 CB16 CB42 CB45 CC17 FA29 FA30

2H096 AA25 AA28 BA10 EA02 HA01 HA03